

半導体用鉛フリー対応小型窒素雰囲気リフロー炉 エコリフロー SNR-615

半導体・ハイブリッド部品、デバイスのソルダーバンプ
アッセンブリー用に最適な鉛フリー対応小型リフロー炉です。



■ 特長:

- 新型ノズル・遠赤外線と対流加熱方式により低 ΔT が実現できます。
- ヒーター毎の温度設定が可能で設定自由度が高く、台形プロファイルが可能です。
上下加熱方式になっており、再現性の高いリフロープロファイルが期待できます。
- 機密性の高いマッフル構造で炉内酸素濃度100ppm以下を維持します。
全ゾーンにおいて200リットル/minで100ppm以下の低窒素消費量を実現します。
(部品高さが基板上10mm以下の場合)
- 加熱部フラックス回収機構を用意しています(オプション)
- 新断熱構造により、省電力エネルギー
- 高温リフロー対応 (MAX. 350℃)

■ SNR-615 : 標準仕様

● 装置寸法	全長: 2,670mm 全幅: 1,100mm 全高: 1,340mm	● 適応基板寸法	幅: 50mm ~ 150mm 長さ: 100mm ~ 300mm
● 搬送速度	0.1 ~ 1.0 m/min 可変	● 部品高さ	基板上: 10 mm (可変式) 下: 5mm 固定
● パスライン	900 ± 20mm	● 制御方式	PLC + PC 制御
● 加熱部	遠赤外線併用ヒーター 6 ゾーン	● 重量	約 1,500kg (標準仕様)
● 冷却部	窒素ガスによる上下冷風冷却	● オプション	指定色、自動幅可変、加熱部フラックス回収 自動濃度コントロール、他。
● 電源 (Max)	三相 200V 43kw		

★性能向上・改善のため、予告なくデザイン及び仕様を変更することがあります。

© 2009 SMIC